附件：

会议日程安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 | 会议ID |
| 4月25日 9：00~12：00，14：00~17：00 | | | | | |
|  | 国标委发[2020]53号20204894-T-469 | 蓝宝石单晶晶棒 | 天通银厦新材料有限公司 | 审定 | 541-538-337 |
|  | 国标委发[2021]19号20211952-T-469 | 蓝宝石单晶用高纯氧化铝 | 山东恒晶新材料有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2020]263号  2020-1202T-YS | 氮化镓衬底片 | 东莞市中镓半导体科技有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2020]263号[2020-1508T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT24992020) | 氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 讨论 |
| 4月26日 9：00~12：00，14：00~17：00 | | | | | |
|  | 国标委发[2020]37号  20202827-T-469 | 氮化硅粉体中氟离子和氯离子含量的测定 离子色谱法 | 新特能源股份有限公司、新疆晶硕新材料有限公司 | 审定 | 601-665-843 |
|  | 国标委发[2020]37号20202918-T-469 | 氮化铝材料中痕量元素（镁、镓）含量及分布的测定 二次离子质谱法 | 北京科技大学、中国科学院半导体研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]37号20202829-T-469 | 半绝缘碳化硅单晶的电阻率非接触测试方法 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 预审 |
|  | [工信厅科函[2020]181号2020-0718T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07052020) | 碳化硅单晶中痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 预审 |
|  | [工信厅科函[2020]181号2020-0719T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07042020) | 高纯镓化学分析方法 第3部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 审定 |